

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成19年9月13日(2007.9.13)

【公表番号】特表2007-506970(P2007-506970A)

【公表日】平成19年3月22日(2007.3.22)

【年通号数】公開・登録公報2007-011

【出願番号】特願2006-527975(P2006-527975)

【国際特許分類】

G 01 N 13/00 (2006.01)

G 01 N 33/50 (2006.01)

G 01 N 33/15 (2006.01)

【F I】

G 01 N 13/00	
G 01 N 33/50	Z
G 01 N 33/15	Z

【手続補正書】

【提出日】平成19年7月25日(2007.7.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1および第2の対向する表面と、前記第1の表面から外側に延在している複数の中空突出部であって、開口部のあるテーパ先端部と、前記突出部内に配置された前記開口部と連続した各キャビティとを有する中空突出部とを有する第1のベースと、

第1および第2の対向する表面を有し、前記第1の表面が、前記複数の中空突出部と係合するよう構成され、第2のベース中へ延在している各キャビティと連続した、複数の窪みテーパ開口部を有する、第2のベースと、

中空突出部が通過できるよう構成された穿孔部を有する保持プレートであって、前記保持プレートが第2のファスニング手段により前記第2のベースに留められており、前記膜が前記第2のベースと前記保持プレートの間に配置されている、保持プレートと、

前記窪みテーパ開口部と前記中空突出部の前記先端部に接触する膜と、  
を含み、前記第1のベースが第1のファスニング手段により前記第2のベースに留められており、a) 中空突出部内の各キャビティは前記第1のベースを通して延在して、前記第1のベースの前記第2の表面に開口部を形成し、またはb) 前記第2のベース内の各キャビティは前記第2のベースを通して延在して、前記第2のベースの前記第2の表面に開口部を形成し、またはc) 中空突出部内の各キャビティは前記第1のベースを通して延在して、前記第1のベースの前記第2の表面に開口部を形成し、前記第2のベース内の各キャビティは前記第2のベースを通して延在して、前記第2のベースの前記第2の表面に開口部を形成する、膜を通して化合物の拡散を測定するシステム。

【請求項2】

請求項1に記載のシステムを提供する工程と、

前記第1のベースの少なくとも1つのキャビティ中に第1の流体組成物を配置する工程と、

前記第2のベースの少なくとも1つのキャビティ中に化合物を含む第2の流体組成物を配置する工程と、

前記第1の流体組成物の前記化合物含量を分析する工程と、  
を含み、前記第1および第2のベースの前記キャビティが膜を介して流体連通している、  
膜を通した化合物の拡散を測定する方法。

【請求項3】

第1および第2の対向する表面と、前記第1の表面から外側に延在している複数の中空  
突出部であって、開口部のあるテーパ先端部と、前記突出部内に配置された前記開口部と  
連続した各キャビティとを有する中空突出部とを有する第1のベースと、

第1および第2の対向する表面を有し、前記第1の表面が、前記複数の中空突出部と係  
合するよう構成され、第2のベース中へ延在している各キャビティと連続した、複数の窪  
みテーパ開口部を有する、第2のベースと、

中空突出部が通過できるよう構成された穿孔部を有する保持プレートと、

前記第2のベースに前記保持プレートを留める手段と、

前記第1のベースを前記第2のベースに留める手段と、

を含み、a) 中空突出部内の各キャビティは前記第1のベースを通して延在して、前記第  
1のベースの前記第2の表面に開口部を形成し、またはb) 前記第2のベース内の各キャ  
ビティは前記第2のベースを通して延在して、前記第2のベースの前記第2の表面に開口  
部を形成し、またはc) 中空突出部内の各キャビティは前記第1のベースを通して延在し  
て、前記第1のベースの前記第2の表面に開口部を形成し、前記第2のベース内の各キャ  
ビティは前記第2のベースを通して延在して、前記第2のベースの前記第2の表面に開口  
部を形成する、膜を保持する、キットの形態にあるシステム。